## 特許協力条約

РСТ

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 150203-221	今後の手続きについては、様式PCT/I	PEA/416を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP2005/005529	国際出願日 (日. 月. 年) 25.03.2005	優先日 (日.月.年) 25.03.2004
	(2006.01)i, B25J9/22(2006.01)i, B65G49/ (2006.01)i, H01L21/22(2006.01)i, H01L21/	
出願人 (氏名又は名称) 東京エレクトロン株式会社		
terminate and the same and the same		

米京ニレクトロン休込芸性
1. この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。
3. この報告には次の附属物件も添付されている。 a. ※ 附属書類は全部で4 ページである。
※ 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙(PCT規則70.16及び実施細則第607号参照)
第 I 欄 4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの 国際予備審査機関が認定した差替え用紙
b. 電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。 配列表に関する補充欄に示すように、電子形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。 (実施細則第 802 号参照)
4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。
第 I 欄 国際予備審査報告の基礎 第 II 欄 優先権 第 III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 第 IV欄 発明の単一性の欠如 第 V欄 P C T 35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 第 VI欄 ある種の引用文献 第 YII 欄 国際出願の不備 第 III 個 国際出願の不備

国際予備審査の請求書を受理した日 25.01.2006	国際予備審査報告を作成した日 21.07.2006		
名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	3 U	9348
日本国特許庁 (IPEA/JP)	八木 誠		
郵便番号100-8915			
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内総	泉 33	2 4

第	I欄	報告の基礎
1.	言語	に関し、この予備審査報告は以下のものを基礎とした。
	-	出願時の言語による国際出願
	1	出願時の言語から次の目的のための言語である 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文
		 国際調査(PCT規則12.3(a)及び23.1(b))
		国際公開 (PCT規則12.4(a))
		国際予備審査 (PCT規則55.2(a)又は55.3(a))
2.		報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され
	た差	替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)
		出願時の国際出願書類
	3:	山駅时の国际山駅青規
	V	明細書
	•	
		第 1-14       ページ、出願時に提出されたもの         第 7       付けで国際予備審査機関が受理したもの         第 7       付けで国際予備審査機関が受理したもの         第 7       付けで国際予備審査機関が受理したもの
		第 付けで国際予備審査機関が受理したもの
		第 付けで国際予備審査機関が受理したもの
	V	請求の範囲
	9.T. /	
		第2,5項、出願時に提出されたもの第項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの
		第 1 . 3 . 4 . 6 項*、F C I I 9 未の規定に塞りる備止されたもの 第 1 . 3 . 4 . 6 項* 2 5 . 0 1 . 2 0 0 6 付けで国際予備審査機関が受理したもの
		第 1, 3, 4, 6項*、25.01.2006付けで国際予備審査機関が受理したもの第 項*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの
	gange	
	Y	図面 The state of the state of
		第 <u>1-14</u>
		第       1-14       ページ/図、出願時に提出されたもの         第       ページ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの         第       ページ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの
	1	配列表又は関連するテーブル
		配列表に関する補充欄を参照すること。
3.		補正により、下記の書類が削除された。
		明細書 第 <u> </u>
		図面
		*: 配列表 (具体的に記載すること) ************************************
4.		この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超
		えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則 70.2(c))
		明細書 第 ページ
		3:
		明細書     第       請求の範囲     第       図面     第       ページ/図
		Mining and a second a second and a second
*	<b>4</b> 1:	に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。
	"	- IN TO AND TO CANDIDATE PROPERTIES OF CHINACAN SECTIONS OF CHINACAN SEC

特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP2005/005529

新規性(N)	見解		
<ul> <li>進歩性(IS) 請求の範囲 1-6</li></ul>	新規性(N)		
産業上の利用可能性(IA)       請求の範囲       1-6       有         対献及び説明(PCT規則70.7)       無		請求の範囲	無
産業上の利用可能性(IA)       請求の範囲       1-6       有無         文献及び説明(PCT規則70.7)       ・請求の範囲1-6について	進歩性(IS)		
請求の範囲       無         文献及び説明 (PCT規則 70.7)         ・請求の範囲 1 — 6 について		請求の範囲	
文献及び説明 (PCT規則 70.7)  • 請求の範囲 1 — 6 について	産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲	<u>1-6</u> 有
<ul><li>請求の範囲1-6について</li></ul>		□目21CV2単UZTI -	
・請求の範囲1-6に何いて 請求の範囲1-6に係る発明については、国際調査報告書で引用したいずれの文稿 こも記載されておらず、当業者にとって自明でもない。			
明かの配面1 0に成分光がに 2、1000人間 でもない。 当業者にとって自明でもない。	<ul><li>請求の範囲1-6に</li></ul>	ついて 核ス発明に	このいては、国際調本報生書で引用したいずれの立場
	- 雨水の軋囲エーりに こも記載されておらず	体の無明に ・ 当業者に	- ついては、国际調宜報音書で引用したい940の文簡 「とって自明でもない。
		、日末日に	- C 7 C E 01 C E 04 C E

## 請求の範囲

[1] (補正後) 熱処理炉と、

多数枚の被処理体を上下方向に所定間隔で多段に保持して前記熱処理炉に搬入 搬出される保持具と、

昇降及び旋回可能な基台と該基台上に進退可能に設けられて被処理体を支持する複数枚の基板支持具とを有し、複数枚の被処理体を所定間隔で収納する収納容器と前記保持具との間で被処理体の移載を行う移載機構であって、前記複数枚の基板支持具のうちの一つが他の基板支持具とは別に単独で進退可能に構成されている、移動機構と、

前記基台に設けられるとともに前記基板支持具の進退方向に向けて光線を出射し、その反射光により、前記保持具内又は収納容器内の被処理体を移載すべき目標 位置に設置される目標部材を検出する検出する第1センサと、

前記一つの基板支持具の2つの先端部に設けられ、両先端部間を進行する光線を 遮ることにより目標部材を検出する第2センサと、

前記第1センサ及び前記第2センサの検出信号と、各検出信号に関連する前記移 載機構の駆動系のエンコーダ値と、に基づいて前記目標位置を割出して認識する制 御部と、

を備えたことを特徴とする縦型熱処理装置。

- [2] 前記目標部材は、前記被処理体と略同形状の基板部と、該基板部上の中心部に 突設され、周面に前記第1センサから出射される光線を反射させる反射面を有する 第1被検出部と、該第1被検出部の上部に一つ設けられるか或いは第1被検出部を 挟む基板部上の対称位置に二つ突設され、前記第2センサにより検出される第2被 検出部と、を備えていることを特徴とする請求項1に記載の縦型熱処理装置。
- [3] (補正後) 前記制御部は、前記目標位置を割り出して認識する際に、前記基台を上下方向に移動させて前記第1センサの検出信号が反転する位置を探し、この反転位置における前記基台の上下移動に関連する駆動系のエンコーダ値に基づいて目標部材の上下方向に関する中心を割り出す第1工程と、前記基台を鉛直軸周りに旋回させて前記第1センサの検出信号が反転する位置を探し、この反転位置における前

## PCT/JP2005/00**552**9 日本国特許庁 **25.** 1. 2006

15/1

記基台の旋回移動に関連する駆動系のエンコーダ値に基づいて目標部材の旋回方 向に関す る中心を割り出す第2工程と、前記一つの基板支持具を前後方向に動作させて前記 第2センサの検出信号が反転する位置を探し、この反転位置における前記一つの基 板支持具の前後移動に関連する駆動系のエンコーダ値に基づいて目標部材の前後 方向に関する中心を割り出す第3工程と、を実行するように構成されていることを特 徴とする請求項1又は2に記載の縦型熱処理装置。

- [4] (補正後) 前記複数の基板支持具はそれぞれ、前記被処理体を前後から挟んで保持する掴み機構を備えていることを特徴とする請求項1に記載の縦型熱処理装置。
- [5] 前記第2センサは、前記保持具内に多段に保持された被処理体に沿って上下方向に走査することにより前記保持具内における該被処理体の状態を検出できるように構成および配置されていることを特徴とする請求項1に記載の縦型熱処理装置。
- [6] (補正後)多数枚の被処理体を上下方向に所定間隔で多段に保持して熱処理炉に搬入搬出される保持具と、昇降及び旋回可能な基台と該基台上に進退可能に設けられて被処理体を支持する複数枚の基板支持具とを有し、複数枚の被処理体を所定間隔で収納する収納容器と前記保持具との間で被処理体の移載を行う移載機構と、を備えた縦型熱処理装置において、前記移載機構をティーチングする方法において、

前記保持具内又は収納容器内の被処理体を移載する所定の目標位置に目標部 材を設置し、

前記複数枚の基板支持具のうちの一つを他の基板支持具とは別に単独で進退可能に構成し、

前記基台に前記基板支持具の進退方向に向けて光線を発射するとともにその反射光により目標部材を検出する第1センサを設けるとともに、前記一つの基板支持具の2つの先端部に、両先端部間を進行する光線を遮ることにより目標部材を検出する第2センサを設け、

前記基台を上下方向に移動させて前記第1センサの検出信号が反転する位置を探し、この反転位置における前記基台の上下移動に関連する駆動系のエンコーダ値に基づいて目標部材の上下方向に関する中心を割り出す第1工程と、前記基台を鉛直軸周りに旋回させて前記第1センサの検出信号が反転する位置を探し、この反

転位置における前記基台の旋回移動に関連する駆動系のエンコーダ値に基づいて 目標部材の旋回方向に関する中心を割り出す第2工程と、前記一つの基板支持具 を他の基板支持具よりも前方に離した状態で前後方向に動作させて前記第2センサ の検出信号が反転する位置を探し、この反転位置に